可変電荷ポテンシャル法を用いた分子動力学計算

\sim Materials Explorer 5.0 \sim

Molecular Dynamics Calculations with Variable Charge Method \sim Materials Explorer 5.0 \sim

高橋 憲彦^a, 增田 裕寿^b, 山崎 隆浩^a, 金田 千穂子^a

Norihiko Takahashi, Yuji Masuda, Takahiro Yamasaki and Chioko Kaneta

1. はじめに

近年,ナノスケールの材料を対象としたシミュレーショ ンの重要性が高まっています。古典的分子動力学(MD)法 はその代表的な手法の一つであり,比較的大きな系に対し て長時間の動力学計算が可能です。本論文において使用し た Materials Explorer(富士通(株)製品)も,古典的分子動 力学ソフトウェアであり,一般的なパソコンで,本格的な シミュレーションを行うことが可能であることから,一般 企業の研究所(化学,電気機器,精密機器,輸送用機器, 情報・通信,電気・ガス,鉄鋼他)および公的研究機関, 大学等の教育機関で広く使用されています。

今回は、Materials Explorer 5.0 (2008 年 1 月発売予定) に 新たに搭載される, 異種材料界面を取り扱うのに有効な新 機能「可変電荷ポテンシャル法」について, 計算手法と, Si/SiO₂ 界面系への適用事例についてご紹介します。

2. 可変電荷ポテンシャル法

2.1 可変電荷ポテンシャル法を用いる理由

MD シミュレーションを行う際,従来は固定電荷ポテンシャルの手法(各原子の電荷を固定して計算を行う手法)が広く用いられてきました。しかしながら,電荷を固定する方法では,例えば半導体/絶縁膜界面などの異種材料界面を扱うのは困難でした。それは,結合形態に応じた原子間の電荷移動があらわに考慮されていないからです。Si/SiO₂界面系を例に考えると,Figure 1 に示されるように,Si 原子は,Si 領域では4個の Si 原子と,界面では2個の Si および2個の O 原子と,SiO₂領域では4個の O 原子と結合しています。Si 原子と O 原子の間には,電気陰性度の差によって電荷移動が生じますが,同じ Si 原子でも各領域で結合している O 原子の数が異なれば電荷の移動量は異なります。このような系に対し固定電荷ポテンシャルを使うには,電荷移動の効果を何らかの形で実効的に他のポテンシャルパラメータに繰り込まなければなら

ず,作成するのが極めて難しいだけでなく適用可能範囲(Si が三配位以下の状態を取る場合などの再現性)も狭くなりま す。これに対して原子間の電荷移動を考慮に入れた可変電荷 ポテンシャルは,モデルとしても自然で,適用可能範囲が広 く,界面領域の原子拡散などの動的現象を扱うのに有利です。

2.2 電荷の計算方法

各 MD ステップにおいて,原子の座標情報をもとにして 電荷を計算します。電荷の計算には,Rappé ら¹が提案した QEq(電荷平衡)法を用います。

まず,系の全静電エネルギーEは各原子の電荷 { $Q_1 \cdots Q_N$ } を用いて次のように表されます。

$$E(Q_1 \cdots Q_N) = \sum_{\mathbf{A}} (E_{\mathbf{A}0} + \chi_{\mathbf{A}}^0 Q_{\mathbf{A}}) + \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{A}, \mathbf{B}} Q_{\mathbf{A}} Q_{\mathbf{B}} J_{\mathbf{A}\mathbf{B}}$$
(1)

$$\Xi \subset \mathfrak{S},$$

$$\begin{cases} E_{A0} : 原子 A の中性状態でのエネルギー $\chi_A^0 : 原子 A の電気陰性度 (2) J_{AB} : 原子 A-B 間の二中心クーロン積分 \end{cases}$$$

です。

(1)式の両辺を Q_A で微分すると,

$$\frac{\partial E}{\partial Q_{\rm A}} \equiv \chi_{\rm A}(Q_1 \cdots Q_N) = \chi_{\rm A}^0 + J_{\rm AA}Q_{\rm A} + \sum_{\rm B \neq A} Q_{\rm B}J_{\rm AB}$$
(3)

ここで, χ_A は原子 A の化学ポテンシャルです。 平衡状態では各原子の化学ポテンシャルが等しくなるので,

$$\chi_1 = \chi_2 = \dots = \chi_N \tag{4}$$

また、全電荷一定の条件から

$$Q_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^{N} Q_i \tag{5}$$

(4) 式と(5) 式から N 個の原子の電荷 {*Q*₁, *Q*₂, …, *Q*_N} に 関する N 個の一次方程式が得られるので, それらを連立し て解くことにより電荷 {*Q*₁, *Q*₂, …, *Q*_N} を求めることがで きます。この連立一次方程式は QEq 方程式と呼ばれ,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ J_{21} - J_{11} & J_{22} - J_{12} & \cdots & J_{2N} - J_{1N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ J_{N1} - J_{11} & J_{N2} - J_{12} & \cdots & J_{NN} - J_{1N} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ \vdots \\ Q_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Q_{\text{tot}} \\ \chi_1^0 - \chi_2^0 \\ \vdots \\ \chi_1^0 - \chi_N^0 \end{pmatrix} (6)$$

と書くことができます。

a 株式会社富士通研究所 シリコンテクノロジ開発研究所 連絡先 〒 243-0197 厚木市森の里若宮 10-1
 電子メール n.taka@jp.fujitsu.com (高橋)
 b 富士通株式会社 バイオ IT 事業開発本部 連絡先 〒 261-8588 千葉市美浜区中瀬 1-9-3

2.3 二中心クーロン積分 J_{ii}

(6)式を解いて各原子の電荷量を決める際には、二中心 クーロン積分 J_{ij} を求めておく必要があります。クーロン積 分の求め方については近似式を用いるなどのいくつかの方 法が提案されていますが、ここでは各原子上に Slater 型の ls 関数 (1s STO) を置いて J_{ij} を解析的に求める手法を用い ます^{1,2}。これにより、クーロン積分を精度良く求めること が可能となります。

2.4 原子に働く力の計算

電荷を計算した後に原子に働く力を計算する必要があり ますが,ここでは可変電荷に対応した Tersoff 型の3体力ポ テンシャル^{3,4}を用いて力を求めています。

3. 可変電荷ポテンシャル法を用いた計算例

Figure 1 に可変電荷ポテンシャル法を用いて計算した Si/SiO₂系の各原子の電荷を示します。Si 領域中では,結合 している Si 原子間で電荷の移動がないので,値はほぼ0 に なります (I)。Si 原子の電荷の値は SiO₂中では約 1.4 (III), 界面ではその半分の約 0.7 (II) となっています。これは, Si 原子に結合している O 原子の数がそれぞれ 4, および 2 であることを反映しています。一方,Si 原子から電荷をも らっている O 原子の電荷は約 -0.7 (IV) で,その絶対値は SiO₂中の Si 原子の電荷の値の半分となっています。また, Figure 1 の構造は第一原理計算ソフトウェア PHASE により 構造最適化を行った⁵ものですが,この構造を出発点として MD 計算を行っても界面構造は保たれます。



Figure 1. Si/SiO₂ structure and charges of Si and O atoms.

Figure 2 は、Materials Explorer のウィンドウ上に表示され た Si/SiO₂ 界面からの SiO 放出シミュレーションの結果です。 これは、界面の酸化過程において、界面付近に存在する過 剰な O 原子が Si 原子と結合し、界面から放出されていく 現象です。このように、原子間の電荷移動を考慮に入れた 可変電荷ポテンシャルによる MD 計算を用いれば、従来の 固定電荷ポテンシャルでは困難であった、界面における拡 散を伴った現象を扱うことが可能となります。



Figure 2. SiO emission in the Si/SiO₂ interface. Snapshots at (a) 0 ps and (b) 31 ps (1800°C).

4. 終わりに

原子間の電荷移動を考慮に入れた可変電荷ポテンシャル の手法と、その適用例について紹介しました。可変電荷ポ テンシャルの手法を用いることにより、従来の固定電荷ポ テンシャルによる取り扱いが困難な異種材料界面の計算を 行うことが可能となります。適用例として、Si/SiO₂界面系 における各原子の電荷の値を示しました。また、Si/SiO₂界 面からのSiO 放出シミュレーションの結果を示しました。

※本論文において,出発点の構造最適化に使用した,文部科学省 「革新的シミュレーションソフトウェアの研究開発」(RSS21) プロ ジェクトで開発された第一原理計算ソフトウェア PHASE は,来年 度から富士通株式会社が取扱いを開始致します。

引用文献

- Rappé, A. K.; Goddard III, W. A. J. Phys. Chem. 1991, 95, 3358-3363.
- (2) Streitz, F. H.; Mintmire, J. W. Phys. Rev. B 1994, 50, 11996–12003.
- (3) Tersoff, J. Phys. Rev. Lett. 1986, 56, 632–635; Tersoff, J. Phys. Rev. B 1989, 39, 5566–5568.
- (4) Kumagai, T.; Izumi, S.; Hara, S.; Sakai, S. "Development of a variable-charge molecular dynamics potential for Si/SiO₂ systems", International Conference on Computational Methods (ICCM 2004), Singapore, 2004, Conference Digest pp. 75.
- Kaneta, C.; Yamasaki, T.; Uchiyama, T.; Uda, T.; Terakura, K. *Microelectronic Engineering* 1999, 48, 117; Yamasaki, T.; Kaneta, C.; Uchiyama, T.; Uda, T.; Terakura, K. *Phys. Rev. B* 2001, 63, 115314.